

分光測定・解析の基礎

日時 2020年11月20日（金）13:00～15:45

場所 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター（本部）

〒135-0064 東京都江東区青海 2-4-10

- ゆりかもめ「テレコムセンター」駅前
- りんかい線「東京テレポート」駅下車 徒歩 15 分 [朝夕無料送迎バスあり 5 分]
都営バス海 01 テレコムセンター駅前下車

受講料 1,400 円

製品の分光測定を通し、その表面を構成する薄膜の厚みや表面性状、屈折率を解析することができます。しかし、測定と解析との間にあるハードルは高く、解析手法を使いこなすには、位相や干渉、散乱など、光の基礎的な部分から理解する必要があります。

本セミナーでは、まず光・および分光測定に関する基礎を再確認します。さらに、分光測定とその結果を利用した解析の事例について講義を行い、理解を深めていただきます。

分光測定に携わっている方々や、その結果を用いた分光解析に興味がある方々、加工、品質保証など幅広い分野の方々の積極的なご参加をお待ちしております。

【新型コロナウイルス感染防止対策へのご協力をお願い】

ご来場の際には必ずマスクの着用および弊センター備え付け消毒液で手指消毒のご協力をお願いいたします。

講座内容・スケジュール

時間	科目	講師
13:00 ~ 14:00	【講義】 分光測定の基礎 分光光度計を用いた光学測定の基礎に関する講義	東京都立産業技術研究センター 磯田 和貴 分光光度計による透過・反射率測定に従事
14:00 ~ 14:15	休憩	
14:15 ~ 15:45	【講義】 分光解析の基礎と解析事例 分光測定で得られたデータとモデルとを用いた解析の基礎および解析事例に関する講義	有限会社テクノ・シナジー 代表取締役 田所 利康氏 分光計測システム、スペクトル解析アプリケーションなどの開発に従事



マスコットキャラクター テリン®

定員

10 名

